

サブテーマ名：高輝度光ビームによる薄膜形成技術に関する研究 小テーマ名：第 族金属窒化物による薄膜創成の開発															
サブテーマリーダー（所属、役職、氏名） 福井工業高等専門学校、教授、太田泰雄 研究従事者（所属、役職、氏名） 日華化学（株）、研究開発本部、南保 幸男															
研究の概要、新規性及び目標 研究の概要 Ga N、I n N薄膜等のセンサー素子としての機能性付与と低温化条件の検討 研究の独自性・新規性 新規電導性膜、電極材料、常温処理 研究の目標（フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に） フェーズ：繊維、合成樹脂に加工する フェーズ：- フェーズ：研究成果の実用化を目指す。															
研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） フェーズ：福井大学 山本教授との共同開発 加工温度の低温化 100 以下達成、センサー素子としての電極材料の加工 フェーズ：- フェーズ：研究成果の実用化を目的として、これまで得られた研究成果をベースに残された研究課題の解決を図る。															
主な成果 具体的な成果内容： Ga N、I n N薄膜（0.1ミクロン）の薄膜の創成と電極材料としての加工 特許件数：0 論文数：0 口頭発表件数：0															
研究成果に関する評価 1 国内外における水準との対比 まだ調査が不十分だが、あまり低温化での条件では検討されておらず新規な技術であると考え る。 2 実用化に向けた波及効果 実際の用途まで考えて実用化を図りたい															
残された課題と対応方針について 電極材料としての評価を行う。 繊維、合成樹脂の表面加工を実施する。															
	J S T 負担分（千円）							地域負担分（千円）							合 計
	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	小計	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	小計	
人件費	0	0	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	133
設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他研究費 （消耗品費、 材料費等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	2,500
旅費	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
その他	0	0	96	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
小 計	0	0	276	0	0	0	276	0	0	2,500	0	0	0	2,500	2,776

代表的な設備名と仕様 [既存 (事業開始前) の設備含む]

ＪＳＴ負担による設備：なし

地域負担による設備：電導度測定装置、各種電極部材等

複数の研究課題に共通した経費については按分する